Влияние влажности и водорода на токоперенос диодных структур на основе *p*-InP с палладиевым контактом

© С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 23 августа 1999 г. Принята к печати 23 августа 1999 г.)

Методами двухступенчатой технологической операции с холодным травлением, полировкой и электрохимическим осаждением палладия создана диодная структура *p*-InP–*n*-In₂O₃–P₂O₅–Pd. Изучен токоперенос в интервале температур 110–300 K, и вольт-амперные характеристики объяснены с учетом туннелирования через барьер, через глубокие центры захвата и межзонного туннелирования. Установлен рост фотоэдс в атмосфере водяных паров и показано, что этот эффект определяется изменением кинетики рекомбинации на связанных состояниях на гетерогранице *n*-In₂O₃–P₂O₅ вследствие поглощения молекул H₂O в окисле P₂O₅. Фотоэдс растет линейно с концентрацией водяных паров, и релаксация импульса фотоэдс $\sim 1-2$ с. Исследована релаксация фотоэдс обратного и прямого тока после действия H₂. Их полученных данных выявлена возможность создания детектора тройного назначения: ближнего инфракрасного излучения, влажности и водорода.

В проведенных нами ранее экспериментальных исследованиях электрических и фотоэлектрических свойств диодных структур с палладиевым контактом на основе InP была показана возможность создания эффективных детекторов (сенсоров) водорода [1–3]. При этом изменение величины фотоэдс в атмосфере водорода может быть существенно больше изменения электрических характеристик, т.е. прямого или обратного тока. Это же ярко продемонстрировано на структурах на основе p(n)-Si [4]. Как оказалось, способ получения диодных структур Pd-p(n)-InP не только влияет на механизм токопереноса, но и приводит к появлению сильной зависимости от других внешних факторов воздействия на структуры, и в частности от влажности [2]. Было установлено, что наиболее сильно изменяется в этом случае фотоэдс, при слабом изменении прямого и обратного тока. Влияние влажности было выявлено только на структурах, полученных электрохимическим осаждением палладия; на структурах с напылением в вакууме Pd этого не наблюдалось. В работе [2] первые данные по зависимости фотоэдс от влажности были получены на структурах Pd-*n*-InP. Настоящая статья представляет результаты исследования токопереноса в структурах Pd-p-InP, полученных электрохимическим осаждением Pd, и влияние на него влажности и водорода.

1. Эксперимент

а) Технология

Для создания диодных структур использовались кристаллы *p*-InP, полученные методом Чохральского, ориентации (100) и с концентрацией дырок $p = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Одной из причин выбора подложки с высокой концентрацией носителей тока было стремление уменьшить времена релаксации после воздействия импульса водяного пара, наблюдавшиеся в работе [2] на структу-

рах с n-InP. Поскольку в этой связи очевидно снижение абсолютной величины фотоэдс, с целью его некоторой компенсации изготовленные диодные структуры длительное время выдерживались на воздухе (около 0.5 года). В результате процессов структурной перестройки, рассмотренных в работе [4], удалось получить нужный уровень фотоответа. Перед осаждением палладия кристаллы подвергались тщательному травлению и полировке для удаления механически поврежденного верхнего слоя, очистке и обезжириванию. При этом было опробовано два варианта, один из которых химическое травление в холодном травителе — оказался наиболее оптимальным. В начале поверхность очищалась последовательно ацетоном, серной кислотой, раствором $H_2SO_4 + H_2O_2 + H_2O$ (1 мин), далее проводилась полировка в полирующем травителе $Br(5\%) + CH_3COOH(95\%)$ и снова упомянутые выше операции очистки. Далее через маску, созданную химически стойким лаком, проводилось электрохимическое осаждение палладия. В состав электролита входили PdCl₂, Na₂PO₄ · 12H₂O, C₆H₅COOH. Осаждение проводилось при температуре $50-60^{\circ}$ C, плотность тока 1 мA/cm^2 . Толщина слоя палладия составляла $\sim 400\,{\rm \AA}$ и активная площадь — $7 \cdot 10^{-2}$ см². Омические контакты к тыловой стороне подложки наносились напылением сплава Ag/Zn.

б) Измерения и их результаты

Были проведены измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) при T = 110 и 300 K, а также температурная зависимость прямого и обратного тока в интервале T = 110-300 К. Измерялась стационарная фотоэдс структур при T = 300 К, ее зависимость от импульсного воздействия водяных паров и водорода. Исследовался процесс релаксации прямого и обратного тока, а также фотоэдс под действием импульсов водяного



10⁻²

 10^{-3}

10

10⁻⁵

I, A

p-InP-n-In₂O₃ $-P_2O_5$ -Pd. *I*, 2 — прямые ветви (+ на p-InP) Ig I = f(V). 3, 4 — обратные ветви Ig I = f(IgV) — верхняя шкала по оси абсцисс. *T*, K: *I*, 3: 300; 2, 4 — 110.



Рис. 2. Температурная зависимость прямого и обратного токов. *V*, В: *1* — 0.2, *2* — 0.2, *3* — 0.42.

пара и водорода. Измерения выполнялись по стационарным методикам с использованием преимущественно ординарных измерительных приборов и устройств.

На рис. 1 представлены типичные вольт-амперные характеристики структур, снятые при T = 110 и 300 К. Характерные особенности их состоят в следующем. Пря-

3* Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 3

мая ветвь может быть представлена зависимостью

$$I \sim \exp \frac{qV}{n_1 kT} \tag{1}$$

при T = 300 К в интервале напряжений ≤ 0.2 В. При этом коэффициент $n_1 = 1.3$ (кривая *I*). С понижением температуры до T = 110 К сохраняется экспоненциальная зависимость, но с величиной $n_1 = 3.4$ (кривая *2*). Обратная ветвь, исключая область смещений ≤ 0.1 В, имеет степенную зависимость (кривые *3* и *4*)

$$I \sim V^{n_2} \tag{2}$$

с $n_2 = 3.3 - 3.5$. Эта зависимость с одинаковым наклоном сохраняется при обеих температурах, причем величины токов различаются не очень существенно. Характер



Рис. 3. Рост фотоэдс (в %) при импульсном действии водяного пара в зависимости от длины волны возбуждающего света.



Рис. 4. Изменение фотоэдс (в %) в зависимости от концентрации водяного пара.

температурной зависимости прямого и обратного токов также имеет определенное сходство (рис. 2). При низких температурах наблюдается небольшой участок постоянства токов, который с ростом температуры переходит в линейную зависимость в функции $\lg I = f(T)$. Обратный ток с увеличением приложенного смещения почти перестает зависеть от температуры (кривая 3 при V = 0.42 B).

Чрезвычайно интересным оказался факт роста фотоэдс в зависимости от влажности (рис. 3–5). На рис. 3 представлена кривая роста фотоэдс в зависимости от спектрального состава возбуждающего излучения при постоянстве импульса водяных паров. Наибольший рост отмечен у коротковолнового и длинноволнового концов спектрального интервала чувствительности фосфида ин-



Рис. 5. Импульс фотоэдс, регистрирующий "импульс" водяного пара.



Рис. 6. Релаксация фотоэдс (1) и обратного тока (2) после импульсного действия водорода.



Рис. 7. Релаксация прямого тока после импульсного действия водорода.

дия. Изменение фотоэдс в зависимости от концентрации водяных паров носит линейный характер (рис. 4). Релаксация фотоэдс под действием импульсов водяного пара как на нарастающем, так и на спадающем участках составляет ≤ 2 с (рис. 5).

На рис. 6 и 7 представлены кривые релаксации фотоэдс, прямого и обратного токов под импульсным действием водорода. Как видно из рисунков, времена релаксации примерно одинаковы для фотоэдс и обратного тока и в 3 раза больше для прямого тока.

2. Обсуждение результатов

2.1. Модель структуры и механизм токопереноса

Анализируя всю совокупность полученных результатов измерений, можно придти к выводу, что объект исследований не является простым диодом Шоттки Pd-*p*-InP. Как вид вольт-амперных характеристик, так и их температурная зависимость отличаются от таковых для обычной структуры металл–полупроводник. Необъяснимыми кажутся явления, связаные с влиянием влажности на фотоэдс. Изменение фотоэдс под импульсным действием водорода, ее релаксация также отличаются от измеренных ранее.

Основываясь на ряде литературных данных по физикохимическим процессам окисления поверхности InP [5–7], с учетом результатов работы [8] для объяснения всех экспериментальных результатов можно предположить модель структуры и ее возможную энергетическую схему, представленные на рис. 8. Сложная диодная структура $Pd-P_2O_5-n-In_2O_3-p-InP$ создалась, на наш взгляд, под влиянием трех основных факторов: 1) холодного



Рис. 8. *а* — технологическая схема структуры; *b* — зонная схема.

травления и полировки, 2) способа электрохимического осаждения палладия и 3) относительно длительной выдержки на воздухе. Возможно, что из первых двух один является основным, а третий — второстепенным. Нам не представилась возможность провести соответствующий физико-химический анализ. Следует отметить в этой связи, что структуру со слоями *n*-In₂O₃ и P₂O₅ удалось получить электрохимическим осаждением с использованием раствора H₃PO₄ в пропиленгликоле [7].

С учетом модели структуры на рис. 8 следует рассматривать возможные механизмы токопереноса. Окисел P_2O_5 считается изолятором с предполагаемой шириной запрещенной зоны $E_G \approx 8$ эВ; $n-In_2O_3$ — частично вырожденный полупроводник с $E_G \approx 3.6$ эВ. Напряжение, приложенное к такой структуре, можно записать

$$V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3, \tag{3}$$

где ΔV_1 — часть напряжения на гетеропереходе *p*-InP-*n*-In₂O₃, ΔV_2 — часть напряжения на гетерогранице *n*-In₂O₃-P₂O₅ и ΔV_3 — напряжение на слое изолятора P₂O₅. Величина пропускаемого через структуру тока будет определяться вкладом соответствующих сопротивлений *R*₁, *R*₂ и *R*₃. В первом приближении можно рассматривать две основные области, ограничивающие ток через структуру: первая — гетерограница *p*-InP-*n*-In₂O₃ (*R*₁) и вторая, связанная с наличием слоя изолятора P₂O₅ и барьера Шоттки (*R*₂ + *R*₃). Величина тока будет

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 3

определяться:

$$I = \frac{V}{R_1(V) + R_2(V) + R_3(V)}.$$
 (4)

Изменение тока в зависимости от напряжения и температуры зависит от относительного вклада в сопротивление двух областей R_1 и $R_2 + R_3$. В этой связи рассмотрим возможный механизм токопереноса у низкотемпературного конца измеренного температурного интервала. Полная независимость тока от температуры при прямом и обратном смещении может рассматриваться как следствие полевой эмиссии. Для второй области в этом случае аналитически туннельный ток может быть представлен [9]

$$I \sim \exp \frac{V}{E_{00}},\tag{5}$$

где E_{00} — почти постоянная величина. Такая зависимость в прямой ветви ВАХ реализуется у диода Шоттки с вырожденным полупроводником. Для T = 110 К $E_{00} = 0.29$ В. С учетом данных по *n*-In₂O₃ с $m_r^* = 0.55m_0$ [10], $\varepsilon = 7$ и предполагаемой концентрации $N_d \leq 10^{20}$ см⁻³, согласно

$$E_{00} = 18.5 \cdot 10^{-15} \left(\frac{N_d}{m_r^* \varepsilon}\right)^{1/2},$$
 (6)

будем иметь $E_{00} \ge 0.1$ В. Поскольку даже при комнатной температуре $E_{00}/kT > 3$, следовало бы ожидать сохранения зависимости (5) во всем температурном интервале. Однако, как видно из рис. 2, этого не наблюдается. Токоперенос в основной части температурного интервала вплоть до $T = 300 \, \text{K}$ может быть объяснен с учетом в (4) определяющего вклада R_1 , обусловленного областью гетерограницы p-InP-n-In2O3. В этой связи может быть применена модель, использованная для данного гетероперехода в работе [8]. В этой модели основной канал токопереноса — туннелирование через центры захвата в $n-In_2O_3$ (рис. 8, b). Так как концентрация дырок в p-InP ниже критической концентрации вырождения, превышающей $10^{19} \,\mathrm{cm}^{-3}$, вторая ступень перехода (B-C) определяется, вероятно, переходом в хвост плотности состояний валентной зоны *p*-InP. Туннельный ток через центры захвата с плотностью D

$$I \simeq A_1 D \exp\left[-\alpha (E_G - qV - qV_n)\right],\tag{7}$$

где A_1 и α — константы, V_n — сдвиг уровня Ферми по отношению к дну зоны проводимости n-In₂O₃. Далее, поскольку $E_G = E_G(0) - \beta T$, где β — температурный коэффициент изменения E_G ,

$$I \simeq A_1 D \exp\{-\alpha [E_G(0) - qV] + \alpha \beta T\}.$$
 (8)

Из (8) следует линейная температурная зависимость $\lg I = f(T)$ при постоянном V и экспоненциальная зависимость от V. Величина наклона прямой туннельного тока (рис. 2, кривая 1) составляет ~ 0.007. Порядок

величны приведенной эффективной массы туннелирующего электрона можно оценить из соотношения

$$rac{8\pi (m_r^*)^{1/2} W q^{3/2} eta}{6qh} \sim 0.007$$

Ширина слоя объемного заряда W оценивается по соотношению для резкого гетероперехода с $N_a = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$:

$$N_d \sim 10^{20} \, {
m cm^{-3}}, \;\; arepsilon = 11 \; ($$
для InP $), \;\; W = \left[rac{arepsilon(V_k-V)}{2\pi q N_a}
ight]^{1/2}$

с $V_k \leq 0.6$ эВ [8]. В этом случае $W = 10^{-6}$ см и при $\beta = 2.9 \cdot 10^{-4}$ эВ/К приведенная эффективная масса $\approx 0.04m_0$. Эта величина близка к рассчитанной для InP из плотности состояний.

Обратная ветвь ВАХ структуры имеет характерную степенную зависимость с одинаковым наклоном $n_2 = 3.3$ при T = 110 и 300 К и с небольшой разницей в абсолютных величинах токов. Эта степенная зависимость в данной структуре может быть объяснена как и в работе [8] межзонным туннелированием. В этом случае экспоненциальная зависимость

$$I \sim \exp\left[-4(2m_r^*)^{1/2}(E_{G1} + \Delta V_c)^{3/2}/3qh(V_d - V)^{1/2}\right]$$
(9)

может быть представлена степенной. Поскольку межзонное туннелирование должно наблюдаться в ограниченном интервале напряжений, прямая 3 на рис. 2, снятая при V = 0.42 В, может определяться туннелированием через вторую область ($R_2 + R_3$) и соответствовать термополевой эмиссии при прямом (для этой области) смещении.

2.2. Фотоэдс структуры и ее зависимость от влажности

Одно из наиболее интересных свойств исследованной структуры — значительное увеличение фоточувствительности (фотоэдс) в присутствии водяных паров. Это явление было впервые обнаружено нами ранее [2] в структурах на основе *n*-InP. Очевидно, что основную роль играет здесь вторая область *n*-In₂O₃–P₂O₅–Pd, причем принципиально важным является наличие промежуточного слоя P_2O_5 как поглотители H_2O . Следует отметить, что в предыдущих наших исследованиях [11,12] диодных структур с палладиевым контактом, полученным напылением Pd в вакууме, это явление никогда не наблюдалось.

Фотоэдс при малых уровнях сигнала, связанных с предельной чувствительностью структуры, можно приближенно представить

$$V_{\rm ph} \simeq I_{\rm ph} R_0, \tag{10}$$

где I_{ph} — ток короткого замыкания и R_0 — сопротивление при нулевом смещении. Таким образом, изменение фотоэдс должно определяться либо изменением

того или другого параметра, либо преимущественным изменением одного из них. Поглощение водяных паров окислом P_2O_5 , естественно, должно привести к изменению свойств слоя окисла и, что очень существенно, к изменению характеристик гетерограницы $n-In_2O_3-P_2O_5$ и P_2O_5-Pd . Опыты показали, что изменения как прямых, так и обратных токов всей структуры под действием импульса водяных паров практически не происходит. Почти аналогичная ситуация и в структурах на основе n-InP [2], где лишь в некоторых образцах наблюдалось наибольшее увеличение обратного тока. В этой связи следует предположить, что рост фотоэдс обусловлен в основном ростом I_{ph} , т.е. в конечном итоге изменением характеристик неравновесных неосновных носителей тока.

Фототок с учетом промежуточного слоя P_2O_5 может быть представлен

$$I_{\rm ph} \simeq \frac{I_{\rm ph0}}{1 + D_1 \sigma_n f_s \exp(bn\chi_n^{1/2}\delta)},\tag{11}$$

где Iph0 — фототок диода Шоттки без промежуточного слоя, D_1 — плотность связанных состояний на гетерогранице $n-In_2O_3-P_2O_5$, σ_n — сечение захвата электрона, *f_s* — вероятность заполнения связанных состояний, b_n — туннельный коэффициент, χ_n — высота барьера полупроводник-изолятор, δ — толщина слоя изолятора Р₂О₅. При поглощении водяных паров, вероятно, нельзя ожидать заметного изменения коэффициента прозрачности окисла $bn\chi_n^{1/2}\delta$. И наоборот, следует ожидать кардиального изменения предэкспоненциального множителя $D_1 \sigma_n f_s$, который отражает рекомбинационные характеристики неосновных носителей тока. Можно предположить, что в отсутствие импульса водяного пара велик рекомбинационный поток неосновных носителей на связанные состояния с плотностью D_1 , находящиеся на гетерогранице *n*-In₂O₃-P₂O₅. При этом в (11) $D_1 \sigma_n f_s \exp(bn\chi_n^{1/2}\delta) > 1$. Под действием импульса водяного пара должна существенно уменьшиться D_1 , что приведет к увеличению времени жизни неосновных носителей τ_n . Возможный механизм такого изменения определяется взаимодействием молекул H₂O со связанными состояниями гетерограницы. По некоторым данным [13], при взаимодействии воды с поверхностью полупроводника в основном не наблюдается диссоциации молекул Н₂О, хотя некоторая чистичная не исключается. Известно, что при действии воды на Р2О5 идет образование ортофосфорной кислоты Н₃РО₄; мы полагаем, что этот процесс не играет существенной роли в течение короткого времени импульса. Установлено, что поглощение H₂O ухудшает характеристики Р2О5 как изолятора, приводя, в частности, к увеличению проводимости. С учетом всех этих факторов можно предположить, что молекулярное поглощение H₂O приводит к "разрыхлению" решетки окисла и образованию новых "дефектных" связанных состояний на гетерогранице и в объеме Р2О5. Эти новые состояния подавляют влияние исходных состояний, снижая их концентрацию D_1 . Поскольку можно считать, что в этом процессе $D_1 \sim 1/N_0$, где N_0 — концентрация поглощенных молекул воды на гетерогранице, то

$$I_{\rm ph} \sim \frac{I_{\rm ph0} N_0}{\sigma_n f_s \exp(bn\chi_n^{1/2}\delta)},\tag{12}$$

т.е. фотоэдс V_{ph} должна быть пропорциональна концентрации водяных паров. На рис. 4 представлена соответствующая линейная характеристика. Из рис. 3 следует, что максимальный рост фотоэдс по абсолютной величине наблюдается на концах спектрального интервала 0.5-1.1 мкм, т.е. в коротковолновой и длинноволновой областях. Такая зависимость, можно полагать, связана со степенью заполнения центров D₁ избыточными неосновными носителями. Высокий уровень возбуждения у края собственного поглощения *p*-InP дает большую концентрацию электронно-дырочных пар, причем величины Δn и Δp могут быть сопоставимы с D_1 . В этих условиях захват связанными состояниями D₁ неосновных носителей меняет рекомбинационные характеристики и запуск импульса водяного пара уже практически не изменяет кинетику рекомбинации. Фактор подавления рекомбинационной активности центров D₁ в этом случае отсутствует. Характерно, что роста фотоэдс практически не наблюдается при $\lambda = 0.8$ мкм, что соответствует максимуму спектральной кривой фотоэдс. В коротковолновой области фототок падает из-за поверхностной рекомбинации у гетерограницы p-InP-n-In₂O₃, в длинноволновой — из-за слабого поглощения в подложке p-InP. В обоих случаях число избыточных носителей у гетерограницы n-In2O3-P2O5 будет невелико и эффект подавления" связанных состояний D₁ эффективно подействует.

Время релаксации импульса фотоэдс (рис. 5) как на восходящей ветви, так и на спадающей невелико, порядка 1–2 с. Этот факт тоже может свидетельствовать в пользу отсутствия диссоциации молекул H₂O при поглощении в окисле P₂O₅ в условиях нашего эксперимента.

2.3. Влияние водорода на электрические характеристики и фотоэдс

Кривые релаксации прямого и обратного токов, а также фотоэдс (рис. 6 и 7) после импульсного воздействия водорода должны отражать особенности механизма токопереноса темновых и световых носителей. Характерным является симметрично-противоположный ход кривых 1 и 2 (рис. 6), определяющих релаксацию фотоэдс и обратного тока. Поскольку для структуры с промежуточным слоем

$$V_{\rm ph} \sim \frac{kT}{q} \ln \left[\frac{I_{\rm ph}}{I_{p0} \exp(bp\chi_p^{1/2}\delta)} + 1 \right], \qquad (13)$$

то из (13) следует, что изменение темнового тока, определяемое $I_{p0} \exp -(bp\chi^{1/2}\delta)$, приводит к противоположному изменению $V_{\rm ph}$.

Ранее уже отмечалось [4], что при диссоциации H_2 на гетерогранице может создаваться дипольный слой, что приводит к увеличению высоты барьера и уменьшению коэффициента прозрачности промежуточного слоя. Так как оба процесса взаимосвязаны, то и времена релаксации обратного тока и фотоэдс одинаковы и составляют ~ 9 мин. Время релаксации прямого тока более чем в 3 раза выше, превышая 30 мин (рис. 7). Причины этого могут быть различны. Одна из более вероятных состоит в том, что образующиеся при поглощении водорода "временные" глубокие центры служат эффективными уровнями захвата основных носителей тока с большим временем релаксации после прекращения импульсов H_2 . Так как величина изменения прямого тока невелика, аналитически трудно оценить глубину этих уровней.

В заключение отметим, что полученные результаты исследования структуры *p*-InP–*n*-In₂O₃–P₂O₅–Pd представляют интерес, с одной стороны, как гибридные структуры с несколькими видами туннельного механизма токопереноса, а с другой — как структуры с потенциальными возможностями тройного детекритования — ближнего инфракрасного излучения, влажности и водорода.

Авторы выражают искреннюю благодарность А.М. Мариновой за помощь в технологии изготовления образцов.

Список литературы

- Г.Г. Ковалевская, Л. Кратепа, М.М. Мередов, А.М. Маринова, С.В. Слободчиков. Письма ЖТФ, 15 (12), 55 (1989).
- [2] Г.Г. Ковалевская, А.М. Маринова, С.В. Слободчиков. ЖТФ, 59 (11), 155 (1989).
- [3] С.В. Слободчиков, Г.Г. Ковалевская, М.М. Мередов, А.В. Пенцов, Е.В. Руссу. Письма ЖТФ, 17 (15), 1 (1991).
- [4] Г.Г. Ковалевская, М.М. Мередов, Е.В. Руссу, Х.М. Салихов, С.В. Слободчиков. ЖТФ, 63 (2), 185 (1993).
- [5] K.M. Geib, C.M. Wilmsen, J. Vac. Sci. Techn., 17, 952 (1980).
- [6] J.F. Wager, D.L. Ellsworth, S.M. Goodnick, C.M. Wilmsen. J. Vac. Sci. Tech., 19, 513 (1981).
- [7] D.H. Lauglin, C.M. Wilmsen. Appl. Phys. Lett., 37 (10), 815 (1980).
- [8] М.М. Мередов, Г.Г. Ковалевская, Е.В. Руссу, С.В. Слободчиков. ФТП, 26 (9), 1590 (1992).
- [9] F.A. Padovani, R. Stratton. Sol. St. Electron., 9, 695 (1966).
- [10] R.L. Weiher. J. Appl. Phys., 33, 2834 (1962).
- [11] Г.Г. Ковалевская, М.М. Мередов, Е.В. Руссу, Х.М. Салихов, С.В. Слободчиков, В.М. Фетисова. ФТП, 26 (10), 1750 (1992).
- [12] С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Х.М. Салихов, М.М. Мередов, А.И. Язлыева. Письма ЖТФ, **21** (19), 50 (1995).
- [13] G.J. Hughes, T.P. Humphreys, V. Montgomery, R.N. Williams. Vacuum, **31** (10–12), 539 (1981).

Редактор В.В. Чалдышев

The influence of humidity and hydrogen on the current transport in p-InP diode structures with palladium contact

S.V. Slobodchikov, Kh.M. Salikhov

loffe Physicotechnical Institute, Russuan Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia